

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公開番号】特開2005-338076(P2005-338076A)

【公開日】平成17年12月8日(2005.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2005-048

【出願番号】特願2005-144359(P2005-144359)

【国際特許分類】

G 01 B 9/02 (2006.01)

G 02 B 5/04 (2006.01)

G 01 V 8/14 (2006.01)

【F I】

G 01 B	9/02	
G 02 B	5/04	D
G 01 V	9/04	C

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月19日(2008.5.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の偏光成分および第2の偏光成分を含む第1の入力ビームの発生源(210)と、前記第1の偏光成分と前記第2の偏光成分とを分離するように配置された偏光ビームスプリッタ(220)と、

前記第1の偏光成分と前記第2の偏光成分を再結合させる前に、前記第1の偏光成分を反射させるように配置された第1の偏光操作レトロリフレクタ(230)と、
からなる干渉計システム。

【請求項2】

前記第1の偏光成分と前記第2の偏光成分を再結合させる前に、前記第2の偏光成分を反射させるように配置された第2の偏光操作レトロリフレクタ(240)を更に含む、請求項1に記載の干渉計システム。

【請求項3】

第1の平面反射器(340)と、前記第1の平面反射器(340)と前記偏光ビームスプリッタ(220)との間に配置された1/4波長板(320)と

をさらに含み、前記偏光ビームスプリッタ(220)からの前記第2の偏光成分は、前記第2の偏光操作レトロリフレクタ(350)で反射される前と、前記第2の偏光操作レトロリフレクタ(350)で反射された後に、一回づつ前記第1の平面反射器(340)で反射される、請求項2に記載の干渉計システム。

【請求項4】

前記第1の偏光成分の経路上に第2の平面反射器(830)をさらに含み、前記1/4波長板(320)が、前記偏光ビームスプリッタ(220)と前記第2の平面反射器(830)との間に配置され、

前記第1の偏光成分の経路上且つ前記第2の偏光成分の経路上に偏光変換レトロリフレクタ(860)をさらに含む、請求項3に記載の干渉計システム。

【請求項 5】

第1の平面反射器(340)と、

前記第1の平面反射器(340)と前記偏光ビームスプリッタ(220)との間に配置された第1の1/4波長板(320)であって、該第1の1/4波長板(320)と前記第1の平面反射器(340)が前記第1の偏光成分の経路上に配置される、第1の1/4波長板(320)と、

第2の平面反射器(430)と、

前記第2の平面反射器(430)と前記偏光ビームスプリッタ(220)との間に配置された第2の1/4波長板(420)であって、該第2の1/4波長板(420)と前記第2の平面反射器(430)が前記第2の偏光成分の経路上に配置される、第2の1/4波長板(420)と、

をさらに含む、請求項1に記載の干渉計システム。